

FYS 4230 Design and modeling of Mikro- og nanosystemer
 Fall 2006
 Book: S.D.Senturia "Microsystem Design"

Kapittel		Sections that are not curriculum / pensum
1	Introduction	
2	An approach to MEMS design	
3	Microfabrication	ikke 3.2.1.2 3.2.4 3.2.6.3 3.2.6.5 3.2.7.3 3.3.3 3.3.6 3.3.7
8	Elasticity	Ikke 8.3
9	Structures	Ikke 9.2.1 9.2.2 9.4 9.6 9.7 9.8
13	Fluids	ikke utledning av Navier Stokes dvs 13.2.4, 13.2.5., 13.2.7 heller ikke 13.2.8 13.3.3 13.3.4 13.4 13.5.5
14	Electronics <u>Bare</u> fig 14.3 og avsnitt 14.4 "Diffused resistor"	
18	A piezoresistive pressure sensor	Ikke 18.3.1 18.3.3 18.3.4
19	A capacitive accelerometer	Ikke 19.3.1 19.3.2 19.3.3

		19.3.4 19.4.3 19.5
20	Electrostatic projection displays	Ikke 20.3 20.4
22	Microsystems for DNA amplification	Ikke 22.4 22.5